

## 研發總中心第七次審議會會議記錄

時 間：九十六年七月十九日（星期四）中午十二時正

地 點：工程學院 研討室（一教二樓）

主持人：芮主任祥鵬

出席者：曾副校長俊元 楊士萱教授 張永宗教授 楊重光教授 蘇昭瑾教授 郭人介教授

彭光輝教授 呂志誠老師 王錫福主任 盧錫全老師 任貽均老師 胡石政老師

林平皓辦事員（賴炎生教授 黃榮堂教授 林世聰教授 請假未出席）

### 壹、中心業務報告：

1. 恭請曾副校長頒發第二屆總中心委員會委員聘函並致詞。
2. 貴儀補助說明
3. 歷年國外專利簡報

### 貳、審議貴儀補助款結果。

提案 1. 薄膜濺鍍系統（機械系）

:儀器維修申請，經決議核給新台幣 20 萬元維修費用。

:原則通過但請機械系補充未來一年儀器使用記錄。

提案 2. 表面輪廓檢測系統（機械系）

:儀器維修申請，經決議核給新台幣 24 萬 5 千元維修費用。

提案 3. 拉曼光譜儀（材質系）

:儀器維修申請，經決議核給新台幣 30 萬元維修費用。

提案 4. 無塵實驗室及附屬設備工程+快速氣相層析表面波檢測器+微粒量

測模擬裝置 Model12100（潔淨技術研發中心）

:儀器維修申請，經決議核給新台幣 25 萬元維修費用。

以上原則通過但請補充下列資料(1). 過去以及未來一年儀器使用記錄 (2). 研發成果績效(3). 收費標準(4). 系配合款(總經費之 20%)，等詳細資料。

### 參、國外專利申請結果。

美國專利申請-高導熱矽膠複合材料（奈米光電磁材料技術研發中心王錫福教授等）

:經決議通過申請補助。

### 肆、臨時提議

### 伍、散會